

标准详细信息	
标准状态	现 行
标准编号	T/CECA 68—2022
中文标题	光刻用AT切石英晶片
英文标题	AT-cut quartz crystal wafers for photolithography
国际标准分类号	ICS 31.140
中国标准分类号	CCS L21
发布日期	2022 - 08 - 04
实施日期	2022 - 08 - 10
起草单位	北京石晶光电科技股份有限公司、唐山国芯晶源电子有限公司、广东惠伦晶体科技股份有限公司、成都泰美克晶体技术有限公司、泰晶科技股份有限公司、东晶电子金华有限公司、烁光特晶科技有限公司、深圳市晶峰晶体科技有限公司、三生电子（天津）有限公司、武汉海创电子股份有限公司、安徽晶赛科技股份有限公司、山东博达光电有限公司、研创科技（惠州）有限公司、汇隆电子（金华）有限公司、鸿星科技（集团）股份有限公司、成都晶宝时频技术股份有限公司、南京中电熊猫晶体科技有限公司、上海锐星微电子科技有限公司。
起草人	院中杰、张营、朱中晓、张立强、郑玉南、刘峰、李宗杰、叶竹之、李辉、王斌、李庆跃、张绍锋、张璇、高艺簪、刘其胜、尚虎、毛晶、张翔、汪鑫、刘盛浦、朱永安、廖巧云、叶国萍、郭正江、石胜雄、刘青彦、杨清明、高志祥、马怀昌。
主要技术内容	本文件规定了光刻用 AT 切石英晶片的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标识、运输、储存。 本文件适用于光刻用 AT 切石英晶片。
是否包含专利信息	否
标准文本	不公开